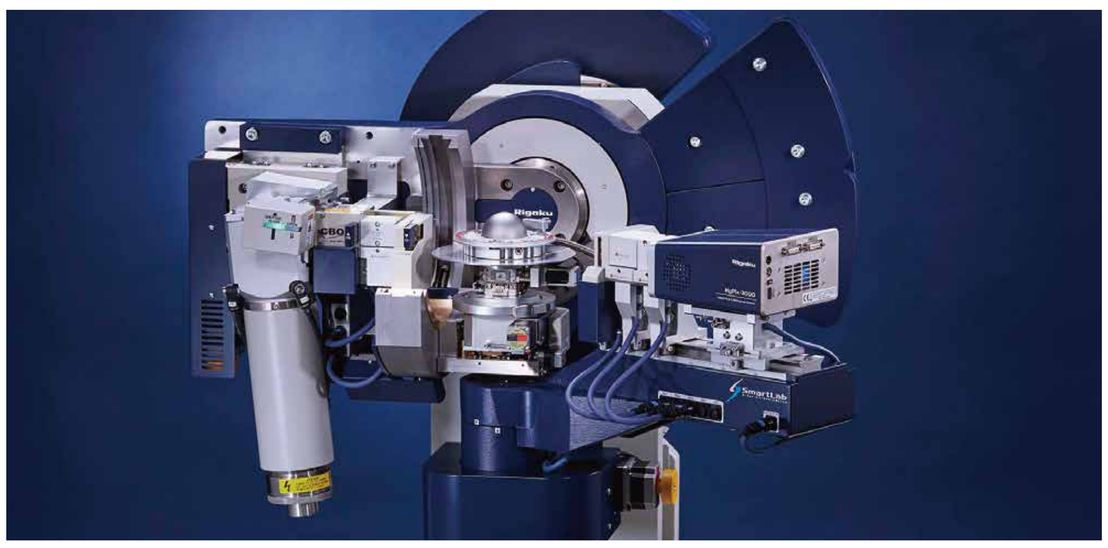
多結晶から単結晶まで
幅広い薄膜材料の評価

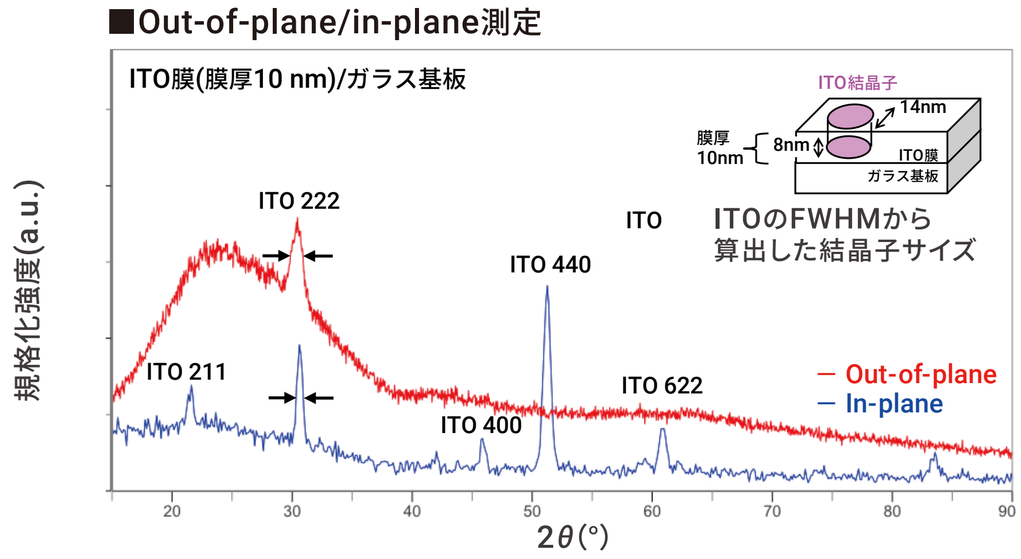
0次元から2次元の測定をこの一台で

全自動多目的X線回折装置 SmartLab

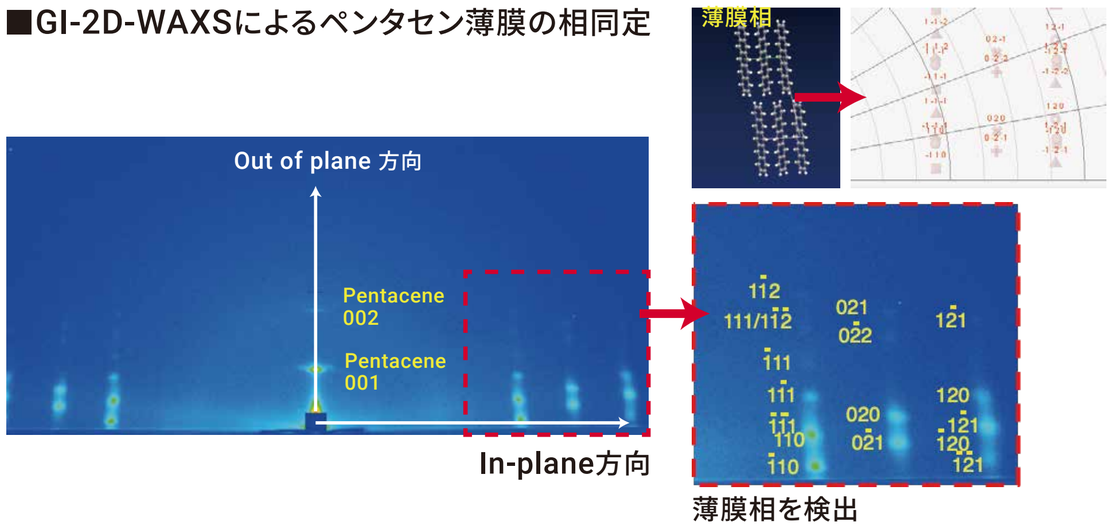
斜入射測定・結晶方位・膜厚など多様な薄膜評価が可能



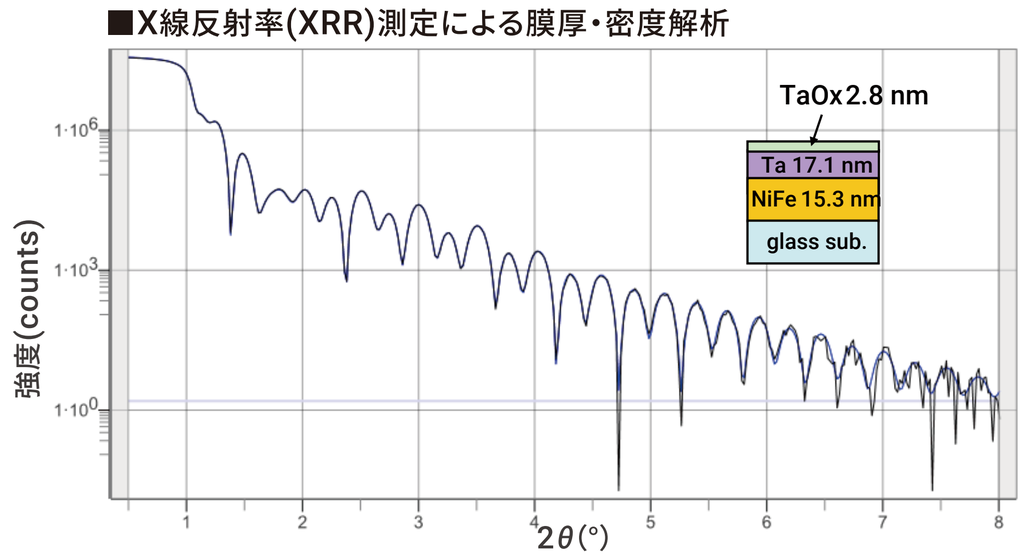
■Out-of-plane/in-plane測定



■GI-2D-WAXSによるペンタセン薄膜の相同定

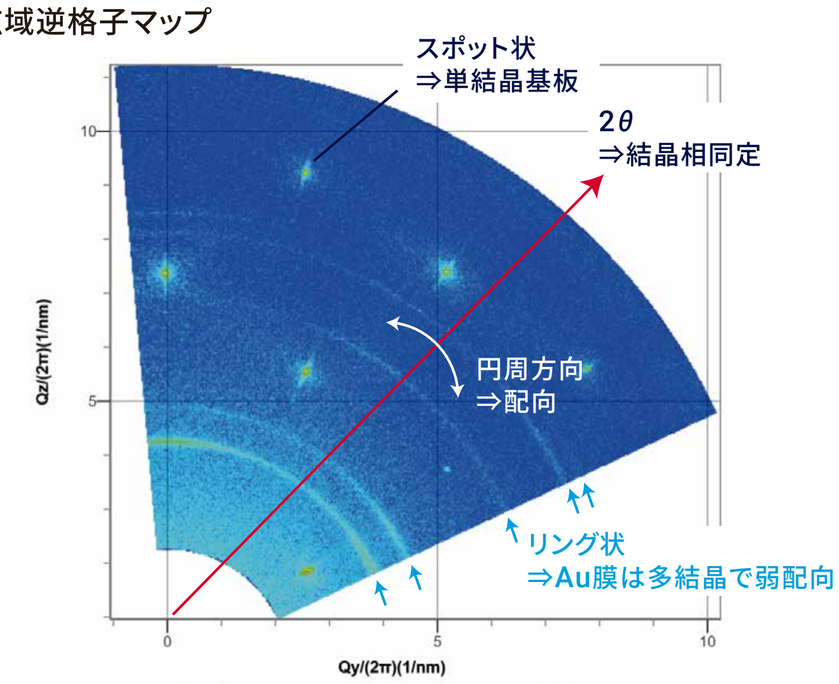


■X線反射率(XRR)測定による膜厚・密度解析



薄膜の結晶方位・配向評価とサポート機能　デモ可能

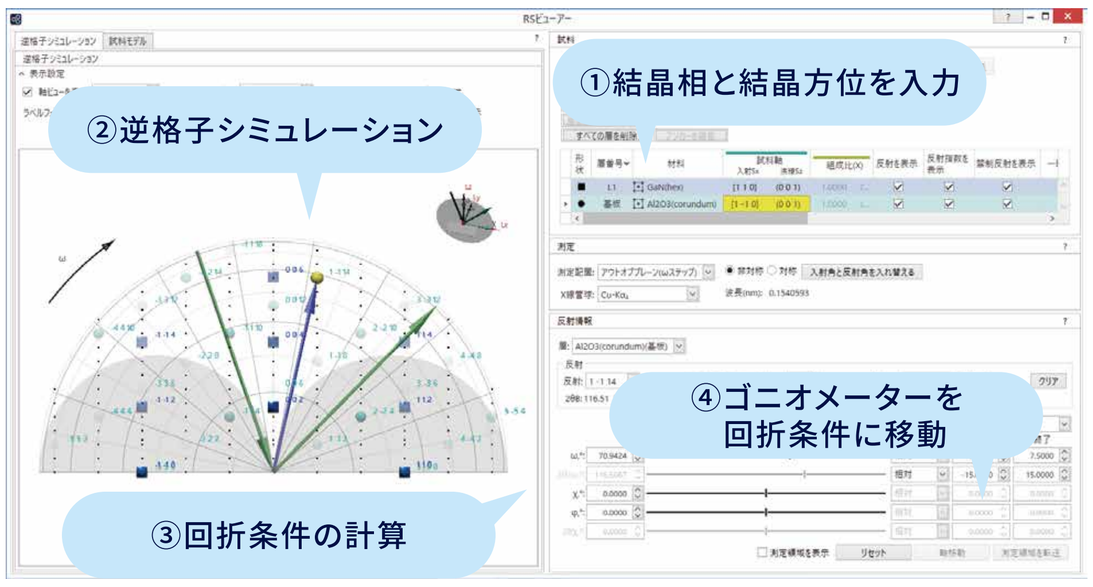
■広域逆格子マップ



Au膜(膜厚30 nm) / Si 100 基板

結晶方位・配向の評価と結晶相同定が可能

■RS Viewer(逆格子シミュレーション)



- 逆格子点の回折条件を計算しゴニオメーターを移動
- 結晶の逆格子や回折条件をシミュレーションし視覚的に表示

Rigaku

rigaku.com

© Rigaku Holdings Corporation and its Global Subsidiaries. All rights reserved.